

SP部会賞

平成 17 年度 SP 部会賞

業績名 強誘電体メモリ材料における量産用スパッタ技術の確立
受賞者所属 株式会社アルバック 半導体技術研究所
受賞者氏名 鄒 紅罌, 増田 健, 西岡 浩, 神保 武人, 菊地 真, 木村 勲

平成 18 年度 SP 部会賞

業績名 High-k ゲート絶縁膜、メタルゲート電極成膜へのスパッタリングによるアプローチ
受賞者所属 キヤノンアネルバ株式会社 エレクトロニクスデバイス装置事業部プロセス技術グループ
受賞者氏名 山田 直樹, 北野 尚武, 小須田 求

平成 19 年度 SP 部会賞

業績名 エピタキシャル Al 電極を用いた SAW デュプレクサの開発・実用化
受賞者所属 株式会社村田製作所¹⁾ 株式会社金沢村田製作所²⁾
受賞者氏名 中川原 修¹⁾, 井上 和裕¹⁾, 渡邊 雅信²⁾

平成 20 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 21 年度 SP 部会賞

業績名 スパッタリングおよびプラズマプロセスに関わるシミュレーションソフトウェアの開発
受賞者所属 ペガサスソフトウェア株式会社
受賞者氏名 田中 正明

平成 22 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 23 年度 SP 部会賞

業績名 磁界を利用した新しいプラズマ成膜プロセスの開発と実用化
受賞者所属 神港精機株式会社¹⁾ 山口大学大学院理工学研究科²⁾
受賞者氏名 野間 正男¹⁾, 小松 永治¹⁾, 諸橋 信一²⁾

平成 24 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 25 年度 SP 部会賞

業績名 パルスオフ期間バイアスを導入したスパッタ成膜過程の研究
受賞者所属 成蹊大学理工学部
受賞者氏名 中野 武雄

平成 26 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 27 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 28 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 29 年度 SP 部会賞 該当業績なし

平成 30 年度 SP 部会賞 該当業績なし

2019年度S P部会賞

業績名 HiPIMS用プラズマ電源の開発

受賞者 東京電子株式会社、中谷達行（岡山理科大学）、福江紘幸（岡山理科大学）

2020年度S P部会賞

業績名 フラットパネルディスプレイの TFT 配線に適用可能な耐久性の高い黒色化スパッタ膜およびスパッタリングターゲットの開発

受賞者 三菱マテリアル株式会社 三田工場 技術開発室

梅本 啓太, 金子 大亮, 岡野 晋, 杉内 幸也, 大友 健志, 塩野 一郎

2022年度S P部会賞

業績名 ストレスコントローラブル高密度 TiN 膜成膜手法『ULTiNA』

受賞者 中野賢明、平松大典、沼田幸展（株式会社アルバック）

以 上